



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202639646 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 02

(21) 申请号 201220305003. 2

(22) 申请日 2012. 06. 28

(73) 专利权人 镓生电线塑料(昆山)有限公司

地址 215335 江苏省苏州市昆山市经济技术
开发区青阳中路 289 号

(72) 发明人 严福笙 黄君逸

(74) 专利代理机构 昆山四方专利事务所 32212

代理人 盛建德

(51) Int. Cl.

B23K 26/04 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

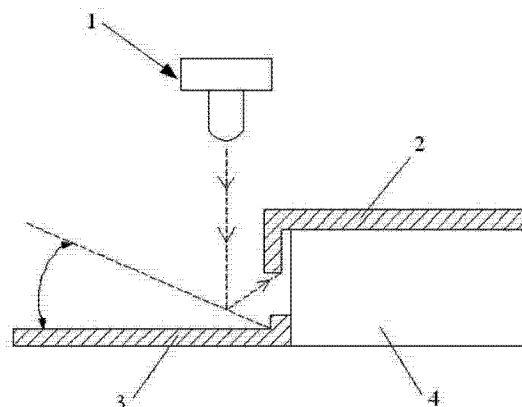
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

镭射加工装置的改良结构

(57) 摘要

本实用新型公开了一种镭射加工装置的改良结构,包括一镭射光源、一镭射工作台面和工件,在所述镭射工作台面上设有一能够活动的反射件,所述反射件与所述镭射光源相对设置,所述工件位于所述反射件与所述镭射光源之间。本实用新型能够将镭射光源精准聚焦于工件的加工处,有效地提高了生产效率和产品良率。



1. 一种镭射加工装置的改良结构,包括一镭射光源(1)、一镭射工作台面和工件(2),其特征在于:在所述镭射工作台面上设有一能够活动的反射件(3),所述反射件与所述镭射光源相对设置,所述工件位于所述反射件与所述镭射光源之间。

2. 根据权利要求1所述的镭射加工装置的改良结构,其特征在于:在所述镭射工作台面上还设有一基座(4),所述工件置于所述基座上。

3. 根据权利要求2所述的镭射加工装置的改良结构,其特征在于:所述反射件呈L型板状结构,所述反射件的拐角处将其分为两个长条段,其中一长条段铰接于所述基座上,另一长条段能够相对所述镭射工作台面位移。

镭射加工装置的改良结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种镭射加工装置领域,尤其涉及一种镭射加工装置的改良结构。

背景技术

[0002] 现有的镭射加工机台,其镭射光源是以 X-Y 轴为常见规格,但是在加工处理一些弹性材料时,则会因为只有二维平面的运动,使得加工自由度受限。

发明内容

[0003] 为了克服上述缺陷,本实用新型提供了一种镭射加工装置的改良结构,该结构简单,能够将镭射光源精准聚焦于工件的加工处,很好的提高了工件良率和工作效率。

[0004] 本实用新型为了解决其技术问题所采用的技术方案是:一种镭射加工装置的改良结构,包括一镭射光源、一镭射工作台面和工件,在所述镭射工作台面上设有一能够活动的反射件,所述反射件与所述镭射光源相对设置,所述工件位于所述反射件与所述镭射光源之间。

[0005] 作为本实用新型的进一步改进,在所述镭射工作台面上还设有一基座,所述工件置于所述基座上。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进,所述反射件呈 L 型板状结构,所述反射件的拐角处将其分为两个长条段,其中一长条段铰接于所述基座上,另一长条段能够相对所述镭射工作台面位移。

[0007] 本实用新型的有益效果是:通过在镭射工作台面上设有一能够活动的反射件,能够将镭射光源精准聚焦于工件的加工处,有效地提高了生产效率和产品良率。而且由于镭射光源不会长时间的停留在反射件的同一点上,因此该反射件不容易被损坏,不会增加生产成本。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面参照附图对本实用新型的镭射加工装置的改良结构的实施例进行详细说明。

[0010] 本实用新型的一种镭射加工装置的改良结构,包括一镭射光源 1、一镭射工作台面和工件 2,在所述镭射工作台面上设有一能够活动的反射件 3,所述反射件与所述镭射光源相对设置,所述工件位于所述反射件与所述镭射光源之间。

[0011] 在本实施例中,在所述镭射工作台面上还设有一基座 4,所述工件置于所述基座上。

[0012] 在本实施例中,所述反射件呈 L 型板状结构,所述反射件的拐角处将其分为两个

长条段,其中一长条段铰接于所述基座上,另一长条段能够相对所述镭射工作台面位移。

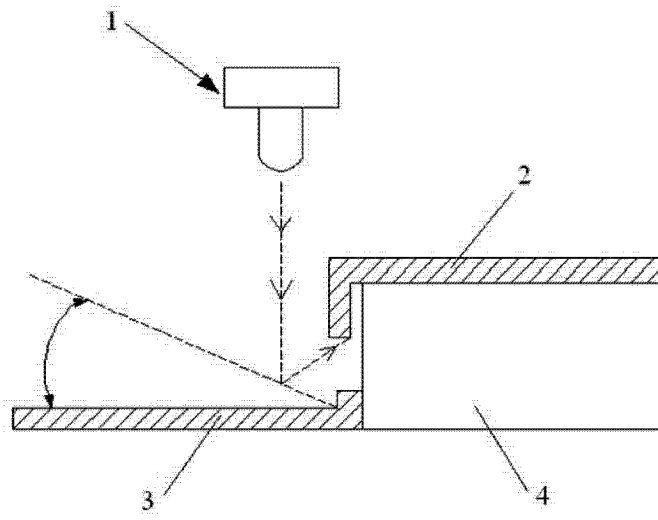


图 1